

日本写真学会 第24回アンビエント技術研究会

アンビエント技術研究会では、写真科学技術の発展的応用の観点から、材料とプロセスの連携に重点を置き、人の周囲にいつでも必要なときに利用できる電子機器環境の実現に役立つ新しい有機電子材料の科学と技術について議論しています。その要素技術の一つであるプリントドエレクトロニクスの世界では、低温溶液プロセスに適した有機半導体材料や金属材料の研究開発が進み、実用レベルの性能を示す素子もできるようになりつつあります。いよいよ、これらの素子を組み合わせる機能デバイスと人との相互作用の最適デザインを描き、それに適合する、素子、プロセス、および材料のめざすべき目標を明確化することが求められます。

第24回の研究会では、新しい製膜プロセスを取り上げ、トナー型の無溶媒製膜法および熔融転写法によりプリントドエレクトロニクス材料を製膜する研究で知見をお持ちの研究者から解説していただき理解を深めたいと考えました。いつも通り、十分に時間を取っておりますので、しっかり議論ができればと思います。是非、奮ってご参加ください。多くのご参加をお待ちしております。

— 記 —

【日時】：2019年12月12日(木) 15:00~18:00

【場所】：東京工芸大学 中野キャンパス 5号館（芸術情報館）3階
5303教室

【定員】：30名

【交通】アクセス⇒ <https://www.t-kougei.ac.jp/guide/campus/nakano/>
(Google Maps) <https://goo.gl/maps/XTHnjfM7Hpoe5T6n6>

【参加費】：無料（ワンコイン情報交換会は500円）

【参加申込】：開催日の1週間前までに以下のURL（または日本写真学会HP）からお申し込みください。

<https://forms.gle/7bhUcz15A4F46T938>（Google Forms）

先着順で受け付けますが、定員を超えた場合はお断りすることもありますので、ご了承ください。

【問合せ】：（一社）日本写真学会事務局 アンビエント技術研究会係

〒164-8678 東京都中野区本町2-9-5 外線 03-3373-0724

E-mail spstj@pht.t-kougei.ac.jp Fax 03-3299-5887



会場付近地図



申し込みURL

【第24回研究会技術テーマと講師】

講演1 15:00~16:00

『トナー型プリントドエレクトロニクスのための金属、有機半導体、絶縁体のパターンニングおよび薄膜化』

千葉大学 大学院工学研究院 准教授 酒井 正俊 先生

講演2 16:00~17:00

『加熱熔融による有機半導体薄膜の作製と応用』

信州大学 学術研究院繊維学系 教授 市川 結 先生

研究会後の17:00~18:00に、講師の先生を囲んでワンコイン情報交換会（500円）を開催いたします。併せて積極的なご参加をお願いいたします。

日本写真学会アンビエント技術研究会

主査：半那純一（東工大）、副主査：稲垣由夫、宮本公明、飯野裕明（東工大）、加藤隆志（富士フイルム）

事務局：山岸治

以上